

## 期刊信息

篇名	Inner surface coating of TiN by grid-enhanced plasma source ion implantation (GEPSII) technique
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	刘斌,张谷令,刘赤子,杨思泽等
第一作者单位	中国科学院物理研究所
刊物名称	J. Vac. Sci. Tech
页面	2001.19.2958
出版日期	2001年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">等离子体离子注入材料内表面改性和制膜</a>